

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 6 部門第 1 区分
 【発行日】平成28年6月23日 (2016.6.23)

【公表番号】特表2015-517676(P2015-517676A)
 【公表日】平成27年6月22日 (2015.6.22)
 【年通号数】公開・登録公報2015-040
 【出願番号】特願2015-514131(P2015-514131)
 【国際特許分類】

G 0 1 N 1/28 (2006.01)

【F I】

G 0 1 N	1/28	F
G 0 1 N	1/28	G
G 0 1 N	1/28	H

【手続補正書】
 【提出日】平成28年5月1日 (2016.5.1)
 【手続補正 1】
 【補正対象書類名】明細書
 【補正対象項目名】0 0 7 9
 【補正方法】変更
 【補正の内容】
 【0 0 7 9】

上部ネック部分 2 1 1 2 を排気するためにイオン・ポンプ 2 1 2 8 が使用される。下室 2 1 2 6 は、真空コントローラ 2 1 3 2 の制御の下、ターボ分子および機械ポンピング・システム 2 1 3 0 によって排気される。この真空システムは、下室 2 1 2 6 に、約 1×10^{-7} トル (1.3×10^{-7} ミリバール) から 5×10^{-4} トル (6.7×10^{-4} ミリバール) の間の真空を提供する。エッチング支援ガス、エッチング遅延ガスまたは付着前駆体ガスを使用する場合、室のバックグラウンド圧力は典型的には約 1×10^{-5} トル (1.3×10^{-5} ミリバール) まで上昇することがある。

【手続補正 2】
 【補正対象書類名】特許請求の範囲
 【補正対象項目名】請求項 8
 【補正方法】変更
 【補正の内容】

【請求項 8】
 前記各動作が、人間の介入なしで自動的に実行される、請求項 7 に記載の方法。

【手続補正 3】
 【補正対象書類名】特許請求の範囲
 【補正対象項目名】請求項 1 9
 【補正方法】変更
 【補正の内容】

【請求項 1 9】

厚さ 1 0 0 n m 未満の薄片を自動的に製作する装置であって、
 イオン・ビーム・カラムと、
 加工物を支持するステージと、
 前記イオン・ビーム・カラムおよび前記ステージの動作を制御するコントローラであり、
 請求項 1 の各動作を実行するためのコンピュータ命令を記憶した記憶装置を含むコントローラと
 を備える装置。